## 微細穴三次元形状測定機 FP-Labo



小坂研究所

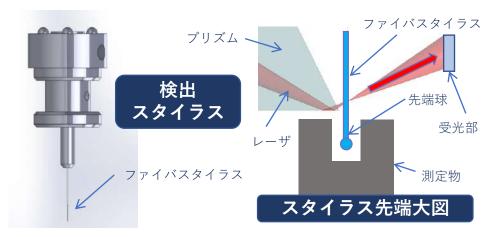
## 「微細穴」の「未知の世界」を「非破壊で可視化」!



### 装置の特長

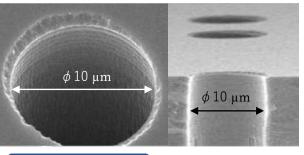
- ・微小な挙動を高精度で検出する画期的な検出制御系を開発。
- ・微細穴  $\phi$  10  $\mu$ m~/深さ~300  $\mu$ mの穴内部形状を測定、可視化。
- ・高分解能 10 nm、低測定圧 0.1 µN以下を実現。
- ・接触による破損から解放される高弾性ファイバスタイラス使用。
- ・穴の内径/外径/深さ、溝の内幅/外幅/深さ、壁面を計測可能。
- · 真円度、円筒度、直径、段差、溝幅、直角度等、 多様な解析機能有。
- ・レシピ作成により自動測定可能。





# 切断(破壊)後の電子顕微鏡計測不要!

半導体チップ TSVの穴内部測定事例



世界で初めて 非破壊計測実現

装置仕様 ※ φ20スタイラスで基準穴を測定した径寸法差

	20	
6 4	0 0	4
42	20	
4	240	p+++++
407	60	
-	************	++++
45.	100	***
<b>*</b>	********	-
20u	140	2um

深さ0~140um ピッチ20um

**φ10 μm**穴を測定

項目	仕様	項目	仕様
最小測定穴径	φ10 μm~	移動軸st. (X,Y,Z)	$50 \times 50 \times 52 \text{ mm}$
最大測定長	$300 \times 300 \times 300 \mu m$	最大サンプルサイズ	$\phi$ 160 mm t=50 mm
測定分解能	10 nm	径寸法の繰り返し	1 σ 0.1 μm 💥
測定力	0.1 μN以下	設置環境クリーン度	ISO クラス 5 推奨
装置寸法W.D.H.	$1,355 \times 1,060 \times 1,745 \text{ mm}$	質量	約400 kg

三郷工場に、評価機を設置しており、いつでもサンプル評価可能です。 自動アライメント・ 6300対応のFP3030もございます。

#### 微細穴三次元形状測定機 **FP3030**



小坂研究所

## 「微細穴」の「未知の世界」を「非破壊で可視化」

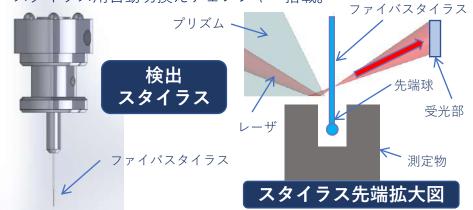






- ・微小な挙動を高精度で検出する画期的な検出制御系を開発。
- ・微細穴  $\phi$  10  $\mu$ m~/深さ~300  $\mu$ mの穴内部形状を測定、可視化。
- ・高分解能 10 nm、低測定圧 0.1 µN以下を実現。
- ・接触による破損から解放される高弾性ファイバスタイラス使用。
- ・穴の内径/外径/深さ、溝の内幅/外幅/深さ、壁面を計測可能。
- · 真円度、円筒度、直径、段差、溝幅、直角度等、 多様な解析機能有。
- ・レシピ作成により自動測定可能。

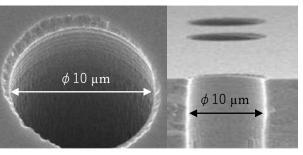
・スタイラス用自動切換えチェンジャー搭載。



本体部

## (破壊)後の電子顕微鏡計測不要!

半導体チップ TSVの穴内部測定事例



世界で初めて 非破壊計測実現

装置仕様 ※ ø 20スタイラスで基準穴を測定した径寸法差

深さ0~140µm ピッチ20µm

φ10 μm穴を測定

項目	仕様	項目	仕様
最小測定穴径	φ10 μm~	移動軸st.(X,Y,Z)	$305 \times 370 \times 52 \text{ mm}$
最大測定長	$300\times300\times300~\mu m$	最大サンプルサイズ	$\phi$ 300 mm t=50 mm
測定分解能	10 nm	径寸法の繰り返し	1 σ 0.1 μm 💥
測定力	0.1 μN以下	設置環境クリーン度	ISO クラス 5 推奨
装置寸法W.D.H.	$1,750 \times 1,310 \times 1,750 \text{ mm}$	質量	約1,650 kg

三郷工場に、評価機を設置しており、いつでもサンプル評価可能です。 マニュアル測定のFP-Laboもございます。